

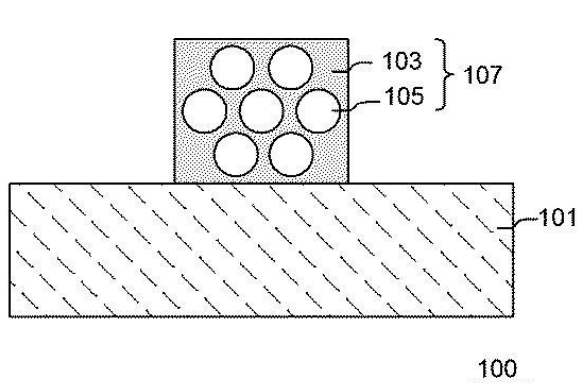
公開番号／特許登録番号	特許6203507
発明の名称	多孔構造体の製造方法
出願人または特許権者	富士電機株式会社 国立大学法人 東京大学

発明の内容 (概要)

本発明は、多孔構造体、多孔構造体の製造方法およびガスセンサに関するもの。

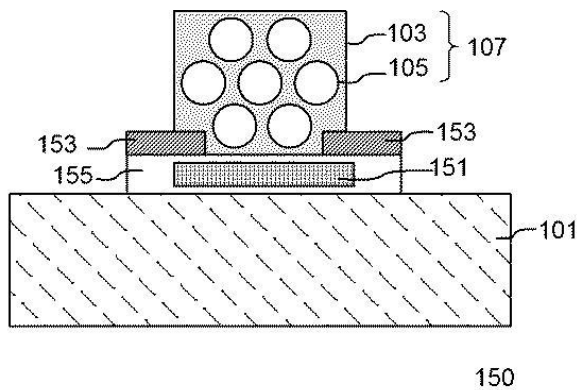
【課題】 基板上に流体の拡散性に優れた多孔体を設けた多孔構造体を提供する。

【解決手段】 本発明の多孔構造体100は、基板101と、基板101上に設けられた多孔体107と、を備える。基板101上に設けられた多孔体107は、隔壁部103と、隔壁部103に囲まれた空隙部105とを有する、逆オパール型のハニカム構造である。



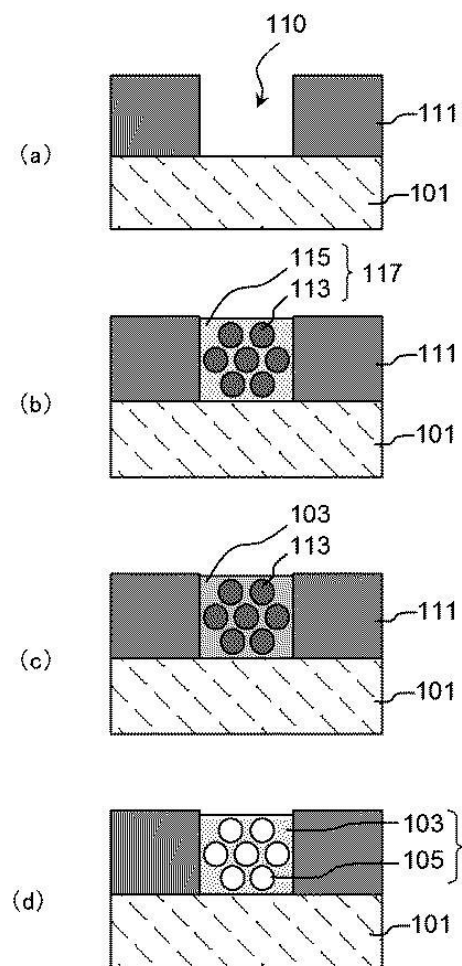
多孔構造体の構成の一例を示す断面図

- | | |
|--------------|---------|
| 100 多孔構造体 | 101 基板 |
| 107 多孔体 | 110 開口部 |
| 115 隔壁部形成用材料 | 117 懸濁液 |
| 153 電極 | 155 絶縁膜 |



ガスセンサの構成の一例を示す断面図

- | | |
|-----------|----------|
| 103 隔壁部 | 105 空隙部 |
| 111 膜 | 113 1次粒子 |
| 150 ガスセンサ | 151 ヒーター |



多孔構造体の製造方法の工程手順を示す工程断面図